PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

58-115838

(43) Date of publication of application: 09.07.1983

(51)Int.CI.

H01L 23/12 H01L 23/08

(21)Application number : **56-214341**

(71)Applicant: NARUMI CHINA CORP

(22)Date of filing:

28.12.1981

(72)Inventor: FUJII HEIHACHI

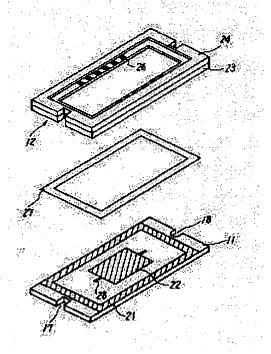
NAKANO SUMIO

(54) LAMINATED CERAMIC PACKAGE

(57)Abstract:

PURPOSE: To minimize a warpage and distortion to be generated on a substrate by a method wherein after the ceramic substrate is baked, a frame body is mounted to be joined.

CONSTITUTION: Metalizations 21, 22 are applied by screen printing, etc., on a green sheet to be used as the substrate, and after the punching process is performed, baking is performed to form the ceramic substrate 11. After metalization 26 is applied by screen printing, etc., on the necessary parts of green sheets to be used as the lower and upper frames 23, 24, and the punching process is performed, they are laminated and baked to form the ceramic frame body 12. By joining the ceramic substrate 11 and the ceramic frame body 12 baked individually with an adhesive material of wax, glass or resin, etc., the laminated ceramic package can be manufactured.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

(JP) 日本国特許庁 (JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭58-115838

⑤ Int. Cl.³H 01 L 23/12

H 01 L 23/12 23/08 H 04 N 5/30

12 08 識別記号 庁内整理番号 7357-5F 7738-5F 6940-5C ⑬公開 昭和58年(1983)7月9日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈積層型セラミックバッケージ

②特 願

願 昭56-214341

@出

昭56(1981)12月28日

⑫発 明 者 藤井平八

名古屋市緑区鳴海町字伝治山3番地鳴海製陶株式会社内

⑫発 明 者 中野澄夫

名古屋市緑区鳴海町字伝治山 3 番地鳴海製陶株式会社内

⑪出 願 人 鳴海製陶株式会社

名古屋市緑区鳴海町字伝治山3

番地

個代 理 人 弁理士 芦田坦

外2名

明細書

1. 発明の名称

積層型セラミックパッケージ

2. 特許請求の範囲

1. 焼成によって形成された平坦なセラミック基板と、該セラミック基板上の一表面に選択的に 被着されたメタライズパターンと、前記セラミック基板とは分離して焼成された枠型の 市記セラミック基板の一表 着層と を有し、前記セラミック 基板の所定位置 たちれていることを特徴とする積層型セラミックパッケージ。

3. 発明の詳細な説明

本発明は複数枚のセラミック板を積層すると とによって構成される積層型セラミックバッケ ーシに関し、特に、固体操像装置を搭載するた めのセラミックバッケージに関するものである。

最近、CCD あるいは MOS 型の半導体案子を用いた種々の固体撮像装置が提案されている。 この固体撮像装置を収納するパッケージは半導体メモリを収納するパッケージに比較してキャビティの底面部が可成大きいのが普通である。

従来、パッケージにおける反りあるいは歪み をなくすために、基板として、コパール等の金 属板をセラミック板の代りに使用することが提 案されている。ことで、通常、基板上には、固体操像装置を搭載するための金メッキ層が施されるととを留意すると、前述したように、基では、本を用いて金メッキを施したのでは、基板をパッケージとなってしまう。また、基板上に、微になったとして金メッキを行なったとして。からなったとして金メッキを行なったとして金メッキを行ないますのメッキ技術では非常に困難である。

本発明の目的は基板における反り及び歪みを 最小限に留めることができる積層型セラミック バッケーンを提供することである。

本発明の他の目的は位置決め寸法精度の高い 積層型セラミックパッケージを提供することで ある。

本発明者等の知見によれば、熱圧着時にグリーンシートの状態で基板上に積層される枠体に加えられる圧力が基板上に不均一な圧力分布となってあらわれ、この結果、基板に反りあるいは歪みが発生することが判明した。この知見に

きるように積層されていることがわかる。

セラミック基板 11のマウント部には、メタライズ層 15 が被着されている。また、枠体 12 の中間領域 14 上には、配線用のメタライズ層 16 が設けられている。これらメタライズ層 15 及び 16 は金メッキ層によって被覆されるのが普通である。

バッケージの対向する側部には、基板 11から 延びる一対の位置決め用ガイド孔 17,18 が形成 されており、各ガイド孔 17,18 は互いに異なる 形状を備えている。

ことで、第1図に示したパッケージを製作する従来の方法を説明する。まず、基板11となるグリーンシートを用意し、メタライズパターンを形成する一方、複数枚の枠型のグリーンシートとの所要個所にもメタライズパターンが形成される。次に、基板11用グリーンシート上に、複数枚の枠型グリーンシートを積層した状態で、ホットプレス機を用いて加熱圧着することによって

基を、本発明では、グリーンシートの状態では 圧力を加えるととなく製作された反りあるいは 歪みのないセラミックパッケージが得られる。

以下, 図面を参照して説明する。

第1図を参照すると、本発明を適用できる積 層型セラミックパッケージの一例として、固体 撮像装置用のバッケージが例示されている。尚、 ことでは、キャップが取り除かれた状態を示し ている。図に示すように、積層型セラミックパ ッケージは底部を形成するセラミック基板 11と。 との基板 11 上に 積層された 額縁状のセラミック 枠体 12 とを備え、枠体 12 は複数枚(この例で は、2枚)のセラミックフレームによって構成 されている。このように、セラミック基板 11上 にセラミック枠体 12を積層することによって。 内側に、マウント部及びキャビティが規定され る。枠体 12 はその上端面にキャップシール領域 13を規定すると共に、シール領域 13 とマウン ト部との間に、中間領域14を規定している。し たがって,複数枚のフレームは内側に段差がで

第1図に示すようなパッケージが得られる。

この方法は基板 11 となるグリーンシートの面積が小さい半導体メモリ用のパッケージを製作する場合には何等問題が生じない。しかしながら、固体撮像装置用パッケージのように、基板11 用のグリーンシートの面積が大きくなると、上述した方法では精度の高いパッケージを製作することができない。

第2図及び第3図を参照して、従来の方法における問題点をより具体的に説明する。第2図に示すように、基板 11 となるグリーンシート 11A を積層してホットブレスを行なった場合、グリーンシート12A を積層してホットブレスを行なった場合、グリーンシート12A の積層部分に、主に圧力が加わり、グリーンシート12A の積層部分に、即ち、グリーンシート12A が加わらないため、マウント部は第2図を形はありに反り上り、変形してしまう。との変形は固体機像装置を搭載した場合、固体機像装置に表ける焦点距離の精度に悪影響を及ぼす。

また、上述したホットプレスの際、ガイド孔 17 部分のグリーンシート11A にも圧力が加わり、 第 3 図に示すような歪みが生じる。このため、 ガイド孔 17 の寸法精度が著しく悪くなってしま う。また、ガイド孔 17 の歪みによってガイド孔 17 が狭隘化してしまうと、以後の作業に支障を きたすこともある。

第4図を参照すると、本発明の一実施例に係る積層型セラミックバッケージは第2図及び第3図と同様に、グリーンテープを用いて製作される。しかしながら、本発明では、反り及び歪みを十分に抑圧することができる。

第4図において、セラミック基板11及びセラミック枠体12とは別々に用意される。 具体的に言えば、基板となるクリーンシート上にスクリーン印刷等によりメタライズを施し、所定の打抜加工を行なった後、焼成することによって、セラミック基板11を形成した。この結果、セラミック基板11には、封着用メタライズ層21及びマウント部メタライズ層22が形成され、目つ、

れた。

このように、本発明ではセラミック基板 11 の焼成後、枠体 12 を搭載しており、且つ、接合の際の圧力はホットプレスの際の圧力に比較して著しく低いため、セラミック基板 11 及びガイト孔 17,18 には反り及び歪みが生じないことが確認された。

また、基板 11 として、セラミックを用いているためメタライズを施すことができる。 このことは 微細パターンを基板上に被着できることを 意味している。したがって、例えば、マウント 部に位置決め用細線 28 等を形成することが可能である。

以上述べた本発明の実施例では、基板の反り を20ミクロン以下、ガイト孔の位置決め寸法精 度を10ミクロン以下にすることができた。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明を適用できる積層型セラミックパッケージを示す斜視図, 第2図は従来にお

対向する基板の2辺には、ガイド孔17及び18 が形成される。

一方、セラミック枠体12は下部及び上部フレーム23及び24となるグリーンシートの必要個所にスクリーン印刷等によりメタライズ26を施し、それぞれ打抜加工を行なった後、互いに積層し、セラミック基板11とは別個に、即ち、セラミック基板11には積層しない状態で、焼成することによって形成された。との場合、枠体12におけるガイド孔の寸法を基板のガイド孔より若干大きくしておけば、以後の位置決め作業を楽に行なえる。

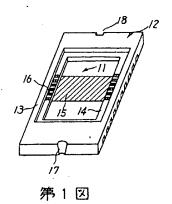
次に、個別に焼成されたセラミック基板 11 とセラミック枠体 12 とをロー、ガラス、又は樹脂等の接合材料により接合することによって、積層型セラミックバッケージを製作した。このため、本発明に係るパッケージには、セラミック基板 11 とセラミック枠体 12 との間に、接合材料層 27 が介在することになる。接合後、通常の方法で露出したメタライズ層に金メッキが施さ

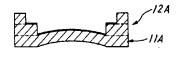
けるセラミックパッケージを概略的に説明するための断面図、第3図は従来のパッケージの側面を拡大して示す図、及び第4図は本発明の一 実施例に係る積層型セラミックパッケージを説明するための分解図である。

記号の説明

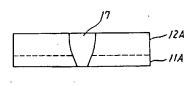
11: セラミック基板 12: セラミック枠体 17,18: ガイド孔 21,22,26: メタライズ層 27:接合材料層

代型人 (7127) 弁理士 後 藤 洋 分





第2図



第3四

